

(19)



Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets



(11)

EP 1 058 106 A1

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag:
06.12.2000 Patentblatt 2000/49

(51) Int. Cl.⁷: G01M 13/02, G01L 5/00

(21) Anmeldenummer: 00111342.2

(22) Anmeldetag: 26.05.2000

(84) Benannte Vertragsstaaten:

AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU
MC NL PT SE

Benannte Erstreckungsstaaten:

AL LT LV MK RO SI

(30) Priorität: 02.06.1999 DE 19925460

(71) Anmelder:

FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR
FÖRDERUNG DER
ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V.
80636 München (DE)

(72) Erfinder:

- Kösel, hans-henning Dipl.-Ing.,
38106 Braunschweig (DE)
- Lange, Nikolas Dipl.-Ing.
38112 Braunschweig (DE)
- Brand, Jochen, Dr.-Ing.-
38126 Braunschweig (DE)
- Lüthje, Holger, Dipl.-Ing.-
25469 halstenbek (DE)

(74) Vertreter:

Pfenning, Meinig & Partner
Mozartstrasse 17
80336 München (DE)

(54) Wälzpaarung

(57) Die Erfindung betrifft eine Wälzpaarung mit zwei gegeneinander laufenden, druckbelasteten Wälzelementen. Auf der Oberfläche mindestens eines der Wälzelemente ist mindestens ein Dünnschichtsensor angeordnet. Der Dünnschichtsensor weist eine tribolo-

gische Funktionsschicht, die den Sensor nach außen abschließt, sowie eine sensorische Schicht, die zwischen der Oberfläche des Wälzelementes und der tribologischen Funktionsschicht angeordnet ist, auf.

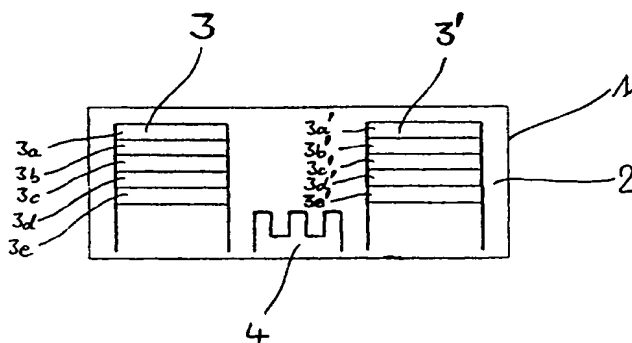


Fig. 1

Beschreibung

[0001] Die vorliegende Anmeldung betrifft eine Wälzpaarung, insbesondere eine Zahnradpaarung mit zwei ineinandergreifenden Zahnrädern. Derartige Wälzpaarungen werden in zahlreichen Bauteilen oder Baugruppen von Maschinen -nachfolgend zusammenfassend als Maschinenelemente bezeichnet- eingesetzt. Bei ineinandergreifenden Wälzpaarungen ergibt sich aus deren Funktion heraus bzw. aus Störeffekten ein Relativbewegungszustand zwischen den sich jeweils berührenden und kraftübertragenden Oberflächen. Aufgrund dieser Relativbewegung treten in sich berührenden Teilen immer Reibungseffekte auf, die die jeweiligen Oberflächen durch Kräfte wie Zug-, Druck- oder Scherkräfte beanspruchen. Außerdem ergibt sich eine Beanspruchung der Oberflächen durch die aufgebrachten äußeren Lasten. Die beschriebene Kombination von Zug-, Druck- sowie Scherkräften und gegebenenfalls Pressung führt in den Oberflächen zu extrem hohen mechanischen Spannungen, großen Deformationen, hohen Temperaturen und insgesamt zum Verschleiß und nach einiger Standzeit schließlich zum Versagen der Zahnräder.

[0002] Eine kontinuierliche Erfassung dieser in den Oberflächen auftretenden Beanspruchungen und des durch sie hervorgerufenen Verschleißes würde wichtige Erkenntnisse für eine verbesserte Dimensionierung entsprechender Wälzpaarungen liefern sowie neuartige Strategien zur Regelung der Betriebsparameter und zur zustandsabhängigen Wartung und Revision dieser Maschinenelemente ermöglichen.

[0003] Aus der EP 0 685 297 A1 ist es bekannt, Werkzeuge für die Umform- und Zerspanungstechnik unmittelbar auf der Verschleißfläche des Werkzeuges mit Sensoren zu versehen, die in Dünnschichttechnik aufgebaut sind. Die EP 0 685 297 A1 offenbart dies beispielsweise für Wendeschneidplatten. Die dort offenbarten Lösungen sind jedoch beispielsweise bei einer Zahnradpaarung aufgrund der gegenläufigen Drehung der ineinandergreifenden Zahnräder nicht anwendbar.

[0004] Die EP 0 844 469 A1 offenbart ein Gleitlager mit einer Achse oder Lagerschale, wobei das Gleitlager Sensoren zur Erfassung der dort auftretenden Kräfte aufweist.

[0005] Die WO 87/04236 offenbart eine mechanische Komponente, auf der in Dünnschichttechnik elektrische Schaltkreise und Wandler aufgebracht sind. Auch diese Schrift beschäftigt sich jedoch nicht mit der Bestimmung von Kräften und dergleichen auf ineinander einkreisenden, einer Relativbewegung unterliegenden Wälzoberflächen.

[0006] Zahnrad isoliert, wenn dieses aus elektrisch leitendem Material besteht. Anschließend wird eine sensorische Schicht mit entsprechenden Dünnschicht-Sensorelementen auf die Oberfläche eines Elementes der Wälzpaarung aufgebracht und zuletzt über diese sensorische Schicht eine abschließende tribologische

Oberfläche als Schicht aufgebracht, die den Sensor nach außen abschließt und mit der übrigen Oberfläche die kraftübertragende Fläche bildet.

[0007] In der sensorischen Schicht können dabei mehrere Sensoren für verschiedene Parameter eingebracht werden, beispielsweise in Form eines Arrays. Dadurch kann zugleich beispielsweise die Temperatur, der Verschleiß und die auf der Oberfläche aufgebrachte Kraft bzw. der Druck bestimmt werden. Mittels laserlithographischer Verfahren kann die sensorische Schicht auch dreidimensional strukturiert werden. Auch photolithographische Verfahren können verwendet werden, um die einzelnen Schichten zu erzeugen.

[0008] Als Sensoren eignen sich resistive Meßprinzipien, beispielsweise für die Temperatur, wobei mit Hilfe von Widerstandsänderungen auch unterschiedliche Zustandsgrößen erfaßt werden können. Es eignen sich weiterhin Dehnungsmeßbrücken oder auch piezoresistive oder auch piezoelektrische Dünnschichtsensoren für die erfindungsgemäße Wälzpaarung. Vorteilhafterweise können die einzelnen Sensoren als Multifunktionssensor ausgebildet sein, bei dem aus einem Schichtmaterial der sensorischen Schicht durch angepaßte Formgebung der Sensor und der Leiterstrukturen verschiedene Sensoren erzeugt werden.

[0009] Zwischen der sensorischen Schicht und der tribologischen Funktionsschicht kann auch eine weitere Isolationsschicht eingebracht werden, so daß die sensorische Schicht auch gegenüber der Oberfläche des Elementes der Wälzpaarung isoliert ist. Die tribologische Funktionsschicht kann vorteilhafterweise aus diamantähnlichen, auf kohlenstoffbasierenden amorphen Schichtsystemen, beispielsweise DLC oder Me:DLC, aus Titanitrid oder Chromnitrid, bestehen.

[0010] Im folgenden werden einige Beispiele einer erfindungsgemäßen Zahnradpaarung beschrieben werden. Es zeigen

Figur 1 eine Zahnradflanke einer Zahnradpaarung;

Figur 2 den Aufbau eines Sensors;

Figur 3 eine schematische Darstellung der Energieversorgung, Signalerfassung, Signalaufbereitung und Signalweiterverarbeitung;

Figur 4 einen Wälzlager-Innenring und

Figur 5 ein Wälzlager mit Übertragungseinrichtungen für Energie und Signale.

[0011] Figur 1 zeigt einen Zahn eines Zahnrades 1 mit einer Zahnflankenoberfläche 2. Auf dieser Zahnflankenoberfläche 2 sind zwei Verschleißsensoren 3, 3' und ein Temperatursensor 4 in Dünnschichttechnologie wie oben beschrieben und auch in Figur 2 dargestellt, aufgebracht. Die Lage der Sensoren wurde dabei so gewählt, daß die Temperatur in den Zonen mit maxima-

ler mechanischer Belastung gemessen wird. Der Verschleiß wird durch die sequentielle Durchtrennung von Widerstandsbahnen 3a bis 3e bzw. 3a' bis 3e' gemessen. Die Dicke der Widerstandsbahn ist dabei so abgestimmt, daß eine lokale Zuordnung erfolgen kann.

[0012] Durch die Verschleißsensoren 3, 3' läßt sich nun auch ohne visuelle Kontrolle der Zahnräder ein Schichtabtrag detektieren und mit Hilfe dieser Daten eine bedarfsgerechte Planung von Wartungs- und Revisionsarbeiten durchführen. Dies ist insbesondere bei hohen Ausfall- und Stillstandskosten oder bei hohen Risiken im Falle eines Versagens der Verzahnung, z.B. in Anlagengetrieben oder in Getrieben von Flugtriebwerken von großem Vorteil. Funktionsstörungen der Getriebebeschmierung lassen sich dagegen indirekt über eine Temperaturüberwachung im Ölreservoir erkennen. Die Temperatur im Zahneingriff, die durch den Sensor 4 erfaßt wird, kann jedoch dabei dennoch erheblich über den im Ölreservoir gemessenen Werten liegen. Der Temperatursensor 4 ermöglicht also ein wesentlich zuverlässigere und mit wesentlich geringerer Verzögerung ansprechende Überwachung und damit die Vermeidung von Überhitzungsschäden.

[0013] Figur 2 zeigt den Schichtaufbau eines Dünnschichtensors, wie er gemäß der Erfindung in die Zahnflanke der Zahnräder einer Zahnradpaarung eingebracht wird. Dieser Schichtaufbau weist zwei dielektrische Schichten 5 und 7 sowie eine dazwischen eingebettete sensorische Schicht 6 auf. Figur 2 zeigt dabei einen Querschnitt, wobei auf die Zahnflanke eines Zahnrades 1 zuerst eine erste isolierende Schicht 5, danach die sensorische Schicht 6 und auf diese eine weitere isolierende Schicht 7 aufgebracht wird. Den Abschluß bildet eine auf die isolierende Schicht 7 aufgebrachte tribologische Funktionsschicht, beispielsweise aus Me:DLC, Titannitrid oder Chromnitrid. Diese tribologische Funktionsschicht schließt mit der äußeren Oberfläche der Zahnflanke ab und bildet einen Teil der Oberfläche der Zahnflanke.

[0014] Die elektrisch isolierende Schicht 5 kann jedoch entfallen, wenn das Zahnrad 1 selbst aus elektrisch isolierendem Material besteht.

[0015] Die Beschichtungsprozesse zur Herstellung eines derartigen Sensors werden in diesem Fall so koordiniert, daß das gesamte System in zwei Prozessen hergestellt wird, zuzüglich der erforderlichen Strukturierung der sensorischen Ebene. Der gesamte Schichtaufbau stellt eine technologische Einheit dar, die materialspezifisch als auch morphologisch optimiert wird, so daß sie die extremen mechanischen und thermischen Belastungen auf Zahnflanken toleriert.

[0016] Erfindungsgemäß können zur Erzeugung der einzelnen Schichten CVD- oder PVD-Beschichtungsverfahren angewandt werden. Die Schichtdicken betragen typischerweise zwischen 1 µm und 10 µm.

[0017] Da bei einer Zahnradpaarung definitionsgemäß eine Relativbewegung zwischen den Zahnflanken der einzelnen Zahnräder auftritt, werden vorteilhafter-

weise die Versorgungsenergie und die gemessenen Signale zwischen der Zahnradpaarung und einer ortsfesten Aufbereitungs- und Auswerteeinheit berührungslos übertragen. Eine derartige berührungslose Übertragung ist in Figur 3 dargestellt. Diese zeigt eine stationäre Einheit, die eine Energieversorgung und einen Sender enthält, um die Energie zu dem Zahnrad zu übertragen. Weiterhin enthält die stationäre Einheit einen Empfänger für Meßsignale und eine Meßsignalverarbeitung, durch die die Signale aufbereitet und weiterverarbeitet werden können.

[0018] In dem Zahnrad sind neben dem erfindungsgemäßen Sensor ein Empfänger für die von der stationären Einheit ausgesandten Energie und zur Weiterleitung dieser empfangenen Energie an den Sensor und die weiteren elektronischen Komponenten in dem Zahnrad angeordnet. Weiterhin befindet sich in dem Zahnrad ein Verstärker zur Verstärkung der vom Sensor erzeugten Meßsignale, ein Analog-Digital-Umsetzer, um die Meßsignale in digitale Signale umzuwandeln, ein Kodierer, um die digitalen Signale zu kodieren und einen Sender, um die kodierten Signale zum Empfänger in der stationären Einheit zu senden.

[0019] Für die Energieversorgung, die Meßsignalverstärkung und Aufbereitung sowie die Analog-Digital-Umsetzung und die Kodierung können dabei grundsätzlich Elektronikschaltungen herkömmlicher Bauart zum Einsatz kommen. Für die Sender-Empfänger-Kombination eignen sich vorteilhafterweise induktive oder optische Übertragungsprinzipien.

[0020] Figur 4 zeigt ein weiteres Beispiel für eine Wälzpaarung mit Hertzscher Pressung, wobei hier ein Lagerring 1 eines Wälzlagers orientierend mit einer funktionsoptimierten Beschichtung versehen ist. Analog zu den vorigen Beispielen können auch weitere Schichten mit spezifischen sensorischen Eigenschaften in das Funktionsschichtsystem integriert werden. Die Beschichtungsverfahren und die typischen Schichtdicken sind wie oben dargestellt.

[0021] Der Lagerring 1 weist zwei Verschleißsensoren 3, 3' und zwei Temperatursensoren 4, 4' auf. Die von diesen Verschleiß- und Temperatursensoren und gegebenenfalls durch weitere, hier nicht dargestellte Drucksensoren gewonnenen Daten können für Maschinen, deren Lager in niedrig-viskosen Medien, z.B. Wasser, laufen, zur Erfassung von lagerschädigender Kavitation bzw. kavitationsbegünstigender Betriebszustände eingesetzt werden. Durch die Verschleißsensoren 3, 3' läßt sich auch ohne visuelle Kontrolle der Lager des Wälzlagers 1 ein Schichtabtrag erfassen und mit Hilfe dieser Daten eine bedarfsgerechte Planung von wartungs- und Revisionsarbeiten durchführen. Mit Hilfe dieser sämtlicher über die integrierten Sensoren des Lagerrings 1 gewonnenen Daten können insgesamt kavitationsgefährdete Betriebsbereiche über Steuerung oder Regelung geeigneter Betriebsparameter für die Wälzpaarung vermieden werden.

[0022] Figur 5 zeigt ein weiteres Beispiel für den

Einsatz von bewegten und ortsfesten Elektronikkomponenten zur Energie- und Meßsignalübertragung von bzw. zu einem mit Dünnschichtsensorik bestückten Wälzlager in einer Maschine. Figur 5 zeigt dabei ein Maschinengehäuseteil 10, in dem eine rotierende Welle 14 gelagert ist. Die rotierende Welle ist in einem Lagerinnenring 16 gelagert, der seinerseits die erfindungsgemäße Dünnschichtsensorik, hier nicht im Detail dargestellt, aufweist. Von dieser Sensorik erstrecken sich Anschlußleitungen 15 zu einem Elektronikträger 13, der mit der Welle 14 rotiert. Auf dem Elektronikträger ist eine Platine angeordnet, die sowohl als Energieempfänger als auch als Meßdatensender wirkt. In dem Maschinengehäuseteil 10, dem rotierenden Elektronikträger 13 gegenüber angeordnet, befindet sich ein Meßdatenempfänger und ein Energiesender. Diese nehmen die Meßsignale von dem Meßdatensender des Elektronikträgers 13 berührungslos auf und senden ihrerseits Versorgungsenergie berührungslos an den Energieempfänger des Elektronikträgers 13. Der Meßdatenempfänger und der Energiesender, die in dem Maschinengehäuseteil 10 angeordnet sind, weisen Anschlüsse 11 für die stationäre Energieversorgung sowie Anschlüsse 12 für die stationäre Meßdatenerfassung und -aufbereitung auf. Damit ist es möglich, sowohl die Energieversorgung zu dem in dem Wälzlager rotierenden Teil, hier einer Welle 14, aufrecht zu erhalten als auch die Meßdaten von der Dünnschichtsensorik im Lagerinnenring 16 berührungslos nach außen zu übertragen.

Patentansprüche

1. Wälzpaarung mit zwei gegeneinander laufenden, druckbelasteten Wälzelementen, dadurch gekennzeichnet, daß
 - auf der Oberfläche mindestens eines der Wälzelemente mindestens ein Dünnschichtsensor angeordnet ist,
 - wobei der Dünnschichtsensor eine tribologische Funktionsschicht, die den Sensor nach außen abschließt, sowie eine sensorische Schicht, die zwischen der Oberfläche des Wälzelementes und der tribologischen Funktionsschicht angeordnet ist, aufweist.
2. Wälzpaarung nach dem vorhergehenden Anspruch, dadurch gekennzeichnet, daß zwischen der Oberfläche des Wälzelementes und der sensorischen Schicht eine elektrisch isolierende Schicht angeordnet ist.
3. Wälzpaarung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die sensorische Schicht ein Dünnschichtsensorelement enthält.
4. Wälzpaarung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die sensorische Schicht eine Dehnungsmeßbrücke, einen piezoelektrischen Dünnschichtsensor und/oder einen piezoresistiven Dünnschichtsensor als Dünnschichtsensorelement enthält.
5. Wälzpaarung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß auf der Oberfläche ein Array oder Netzwerk aus einzelnen Dünnschichtsensorelementen angeordnet sind.
6. Wälzpaarung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Funktionsschicht Me:DLC, Titannitrid und/oder Chromnitrid enthält.
7. Wälzpaarung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Dünnschichtsensor ein Kraftsensor, ein Drucksensor, ein Temperatursensor, ein Deformationssensor oder ein Verschleißsensor ist.
8. Wälzpaarung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß sich zwischen der sensorischen Schicht und der tribologischen Funktionsschicht eine weitere elektrisch isolierende Schicht angeordnet ist.
9. Wälzpaarung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Oberfläche der tribologischen Schicht mit der Oberfläche eines Elementes der Wälzpaarung eine einheitliche, formschlüssige Oberfläche erzeugt.
10. Wälzpaarung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Dünnschichtsensor eine Vorrichtung zur induktiven, optischen Einkopplung von Versorgungsenergie und/oder Auskopplung von Meßsignalen aufweist.
11. Wälzpaarung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Dünnschichtsensor eine Vorrichtung zur Digitalisierung der Meßsignale vor der Auskopplung aufweist.
12. Wälzpaarung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Dünnschichtsensor eine Vorrichtung zur Kodierung der Meßsignale vor der Auskopplung aufweist.
13. Wälzpaarung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Isolierende Schicht, die weitere isolierende Schicht, die sensorische Schicht und/oder die Funktionsschicht eine Dicke zwischen 1 µm und 10 µm aufweisen.

14. Wälzpaarung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß sie eine Zahnradpaarung mit zwei ineinandergreifenden Zahnrädern ist.

5

15. Wälzpaarung nach dem vorhergehenden Anspruch, dadurch gekennzeichnet, daß auf mindestens einer Zahnflanke mindestens eines der Zahnräder ein Dünnschichtsensor angeordnet ist.

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

5

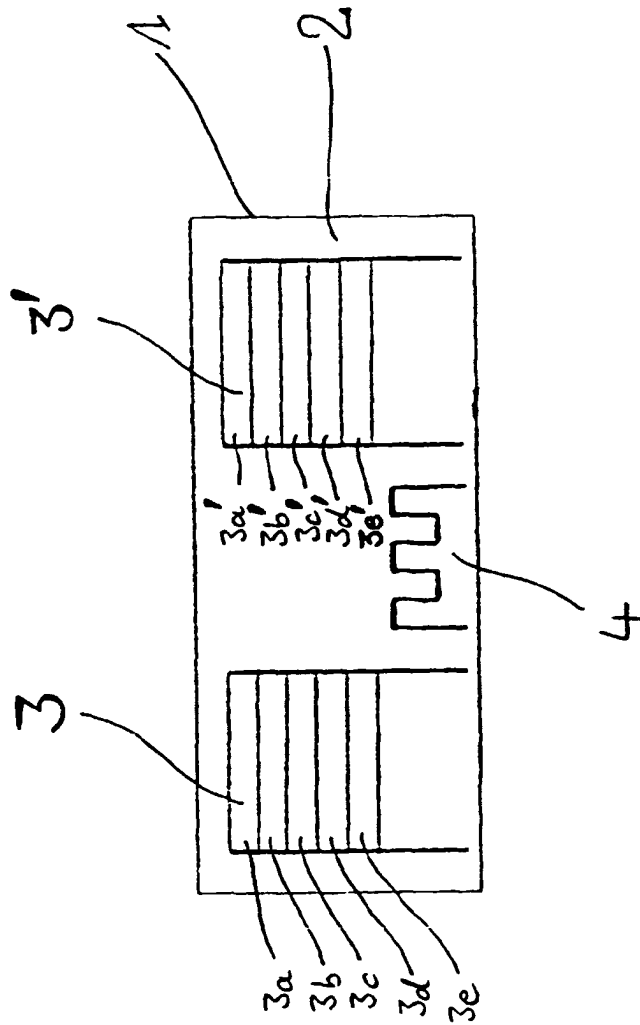


Fig. 1

BEST AVAILABLE COPY

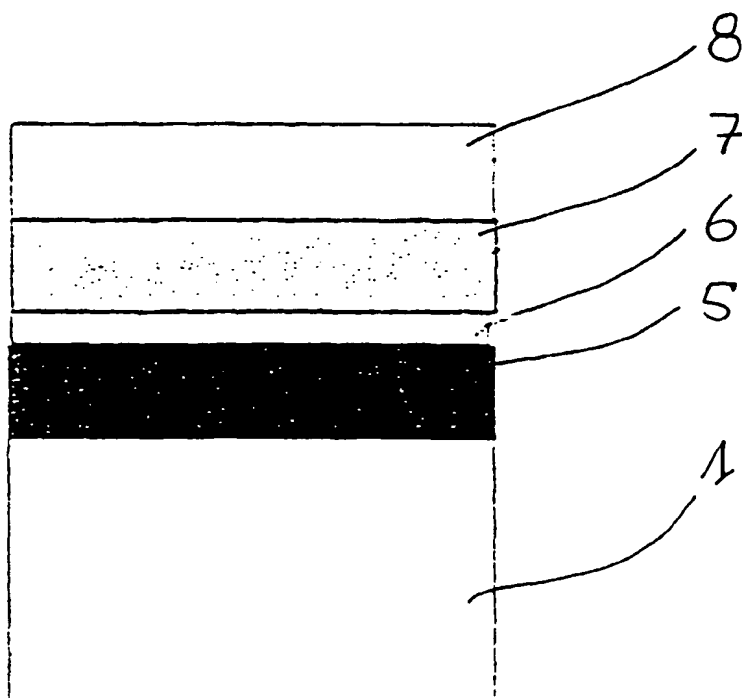


Fig. 2

BEST AVAILABLE COPY

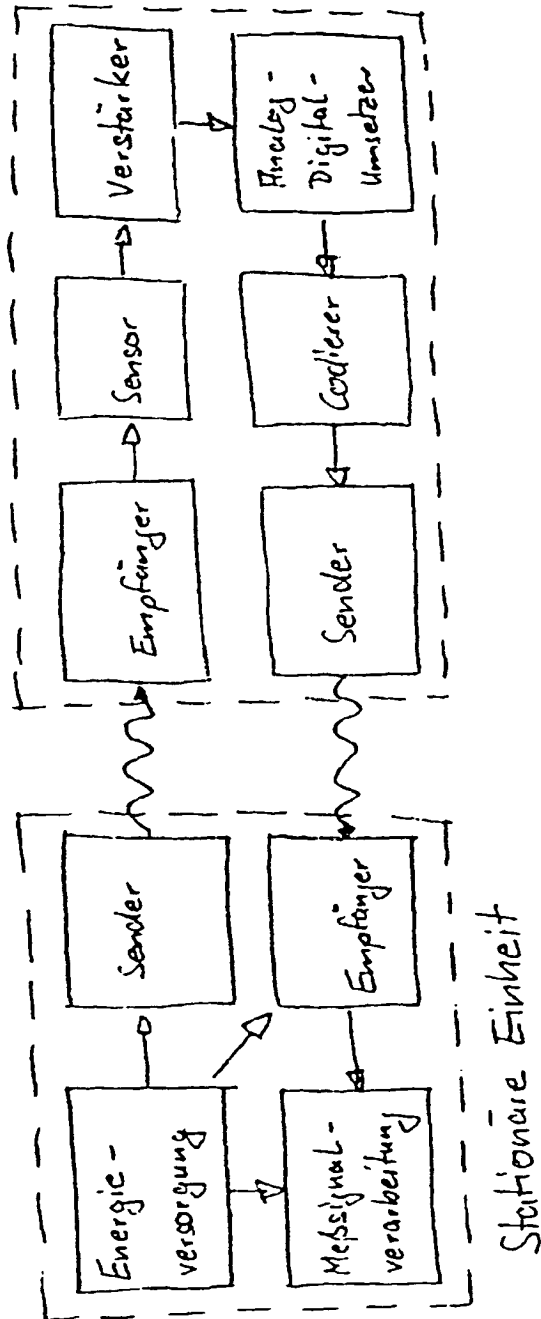


Fig. 3

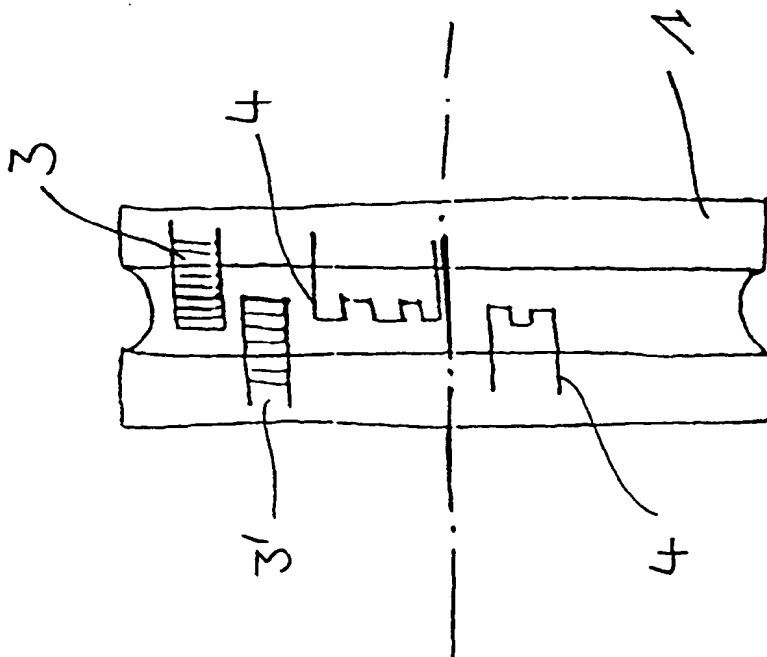
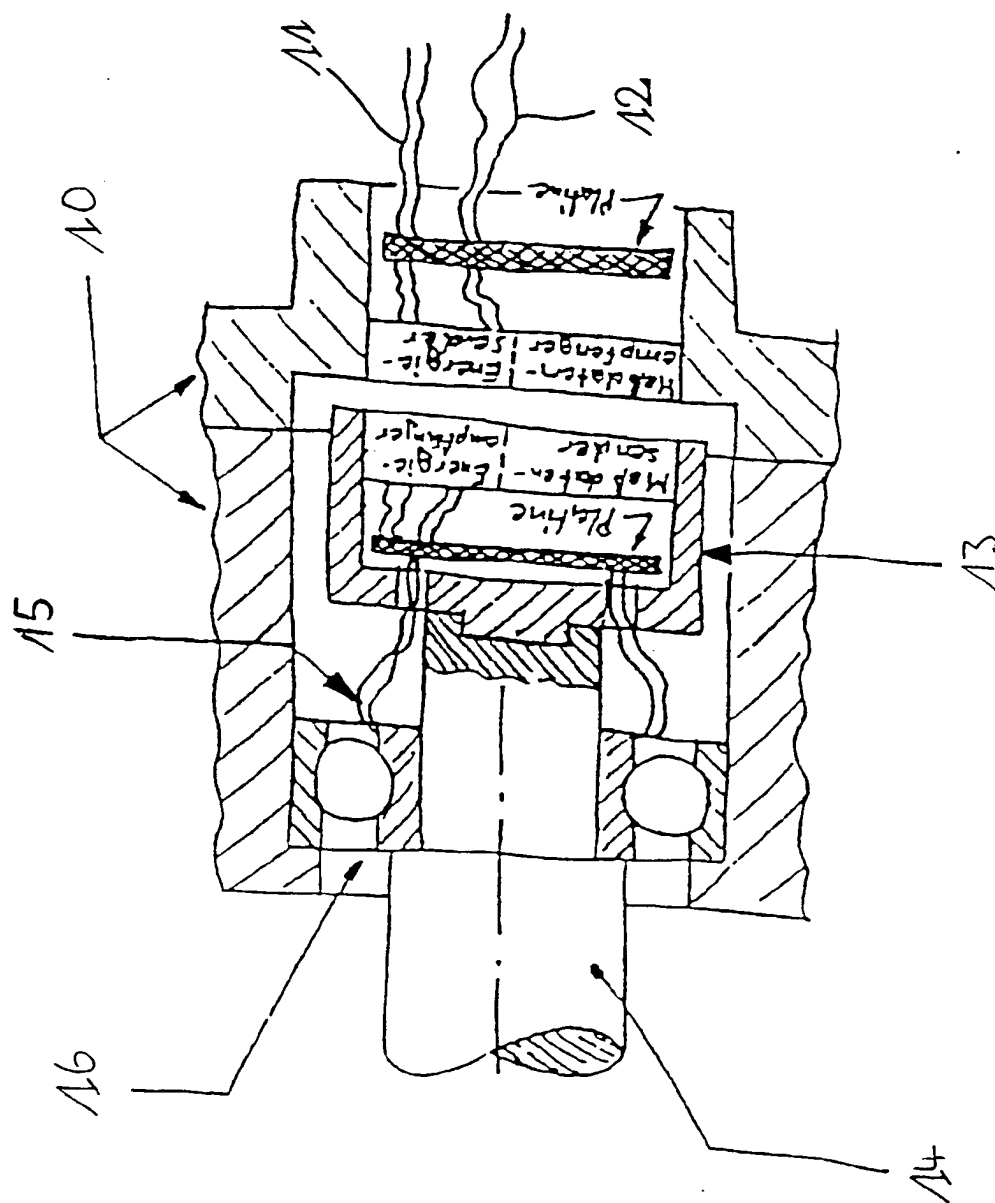


Fig. 4

Fig. 5





Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung
EP 00 11 1342

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.7)
A	US 3 952 418 A (AKAMATSU TOSHIKI ET AL) 27. April 1976 (1976-04-27) * Spalte 2, Zeile 53 - Spalte 3, Zeile 29; Abbildungen 3,4 *	1	G01M13/02 G01L5/00
D,A	EP 0 685 297 A (FRAUNHOFER GES FORSCHUNG) 6. Dezember 1995 (1995-12-06) * Anspruch 1 *	1-15	
A	US 5 176 053 A (ALVELID BIRGER ET AL) 5. Januar 1993 (1993-01-05) * Anspruch 1; Abbildungen 4,6 *		
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.7)
			G01M G01L B23F
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort DEN HAAG		Abschlußdatum der Recherche 20. September 2000	Prüfer Mucs, A
<p>KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE</p> <p>X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur</p> <p>T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument</p>			

EPO FORM 1603 03.02 (P04C03)

**ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT
ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.**

EP 00 11 1342

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patentedokumente angegeben.
Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am
Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

20-09-2000

Im Recherchenbericht angeführtes Patentedokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
US 3952418	A	27-04-1976	DE	2504858 A	01-04-1976
EP 0685297	A	06-12-1995	DE	4419393 A	07-12-1995
			AT	190888 T	15-04-2000
			DE	59508025 D	27-04-2000
			FI	952616 A	01-12-1995
US 5176053	A	05-01-1993	SE	460403 B	09-10-1989
			SE	8704079 A	21-04-1989
			WO	9005607 A	31-05-1990

EPO FORM P0461

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts, Nr.12/82